

Title (en)

Device for physical and/or chemical treatment of parts

Title (de)

Vorrichtung zur physikalischen und/oder chemischen Behandlung von Teilen

Title (fr)

Dispositif destiné au traitement chimique et/ou physique de pièces

Publication

**EP 1898170 A2 20080312 (DE)**

Application

**EP 07017379 A 20070905**

Priority

- DE 102006041625 A 20060905
- DE 102006041626 A 20060905

Abstract (en)

The treatment equipment (1) is divided into two or more treatment chambers (2) through which extends the conveying path (3, 4) for the components. Each treatment chamber includes provision for gas removal (12). Gas inlets (10, 11) introduce carrier- and/or reaction gases. Each chamber has a recirculation unit (5) for the gases. Each chamber includes gas guidance baffles (7, 8) bringing the gas into contact with the components to be treated. Gas outlets (12) are located in pressurized regions of the treatment chamber; they are alternatively located in regions of reduced pressure and gas is removed under suction. Valves can be opened or closed to remove gases selectively from one or more treatment chambers. Each treatment chamber includes its own post-treatment chamber (a gas incineration chamber) for the gases led away, and/or the gases enter a manifold leading to a common gas treatment chamber.

Abstract (de)

Es wird eine Vorrichtung zur physikalischen und/oder chemischen Behandlung von Teilen unter Verwendung eines Träger- und/oder Reaktionsgases, insbesondere zur Entbinderung von Formteilen, beschrieben. Die zu behandelnden Teile werden entlang einem Förderweg durch die Vorrichtung geführt und dabei mit dem Träger- und/oder Reaktionsgas beaufschlagt. Die Vorrichtung weist in Förderrichtung der Teile mindestens zwei hintereinander angeordnete Behandlungskammern auf, durch die sich der Förderweg erstreckt, wobei jede Behandlungskammer eigene Einführeinrichtungen für das Träger- und/oder Reaktionsgas aufweist. Jede Behandlungskammer weist ferner zumindest einen Teil einer Umwälzeinrichtung für das Träger- und/oder Reaktionsgas auf. Gasleiteinrichtungen sorgen für eine Beaufschlagung der Teile quer zur Förderrichtung derselben.

IPC 8 full level

**F27B 9/30** (2006.01); **F27B 9/02** (2006.01)

CPC (source: EP)

**F27B 9/3005** (2013.01); **F27D 7/04** (2013.01)

Citation (applicant)

- US 2001051323 A1 20011213 - NISHIMURA MAKOTO [JP]
- US 6345757 B1 20020212 - SAKUYAMA SEIKI [JP], et al
- EP 0789210 A1 19970813 - EBNER PETER H [AT]

Cited by

US11650013B2; US9556072B2; EP3401628A1; RU2764669C2; WO2018206383A1; WO2008063538A3; TWI759478B

Designated contracting state (EPC)

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL PL PT RO SE SI SK TR

Designated extension state (EPC)

AL BA HR MK RS

DOCDB simple family (publication)

**EP 1898170 A2 20080312; EP 1898170 A3 20080827**

DOCDB simple family (application)

**EP 07017379 A 20070905**